

SEMI Standards Staff Report

标准
Normen
規格
Standards
標準
기준
Стандарты

Rev 0.4

June 2009 Committee Meetings

Japan Standards Dept.



目次

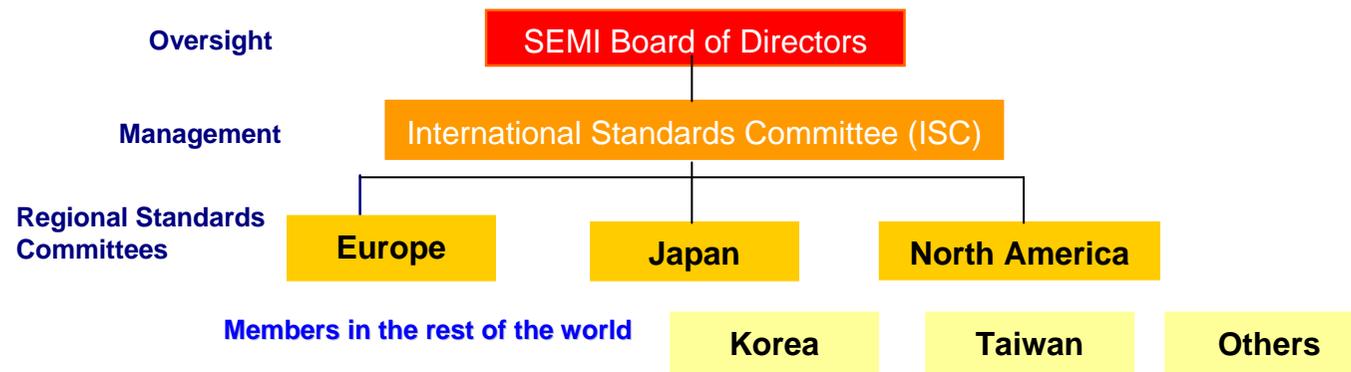
- 組織
- スタッフ体制
- 年間スケジュール
- スタンドアード開発のサイクル
- 直近の手續審査結果
- 出版形態の変化について

- Global PV Committeeメンバー（登録者）の業界セクター別データ報告（前回委員会AI）

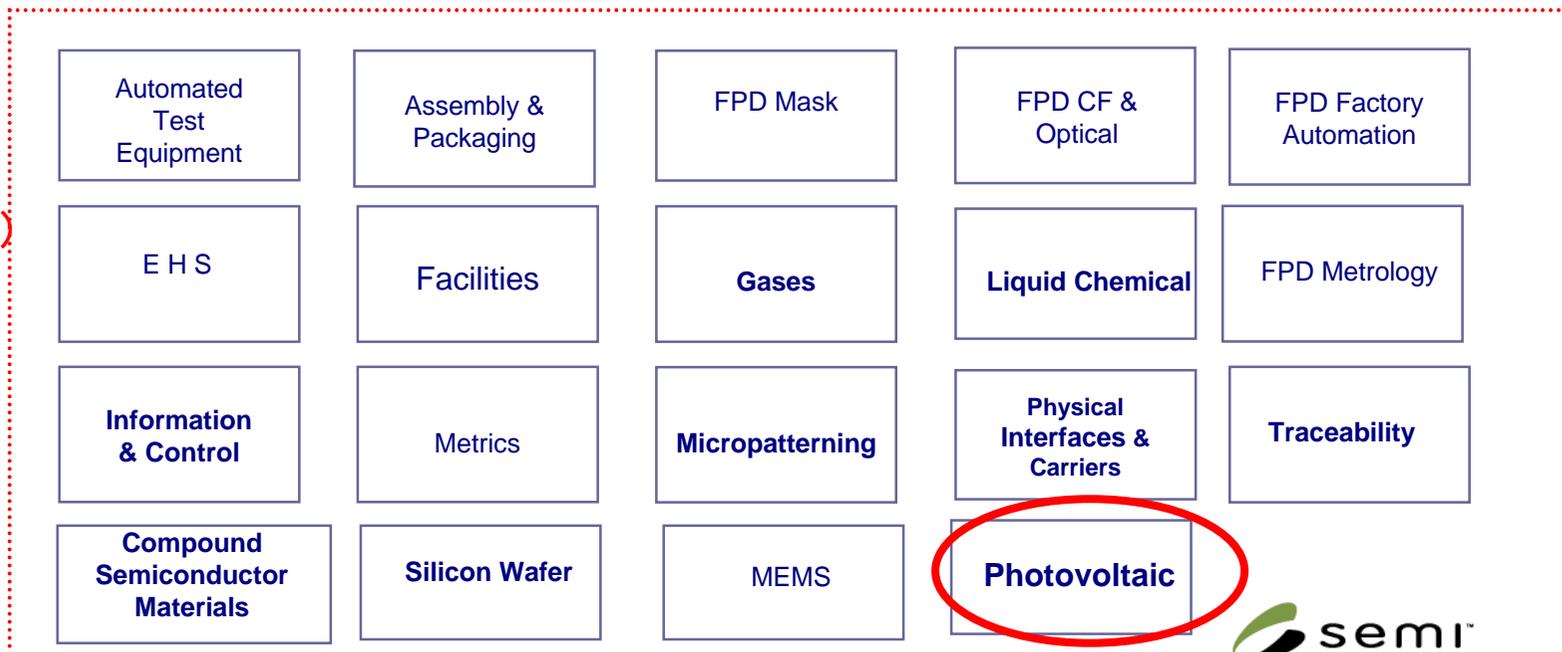
委員会活動経緯(2009年)

- 4月13日: JRSC(日本地区スタンダード委員会)による「日本地区PV技術委員会」新設支持が可決
- 4月23日: 日本地区PV技術委員会キックオフ会議
- 5月12日: Start Up Forum第1回会議
- 5月末: ISC(国際スタンダード委員会)による日本地区PV技術委員会承認
- 6月9日: Start Up Forum第2回会議
- 6月26日: 第2回日本地区PV技術委員会会議

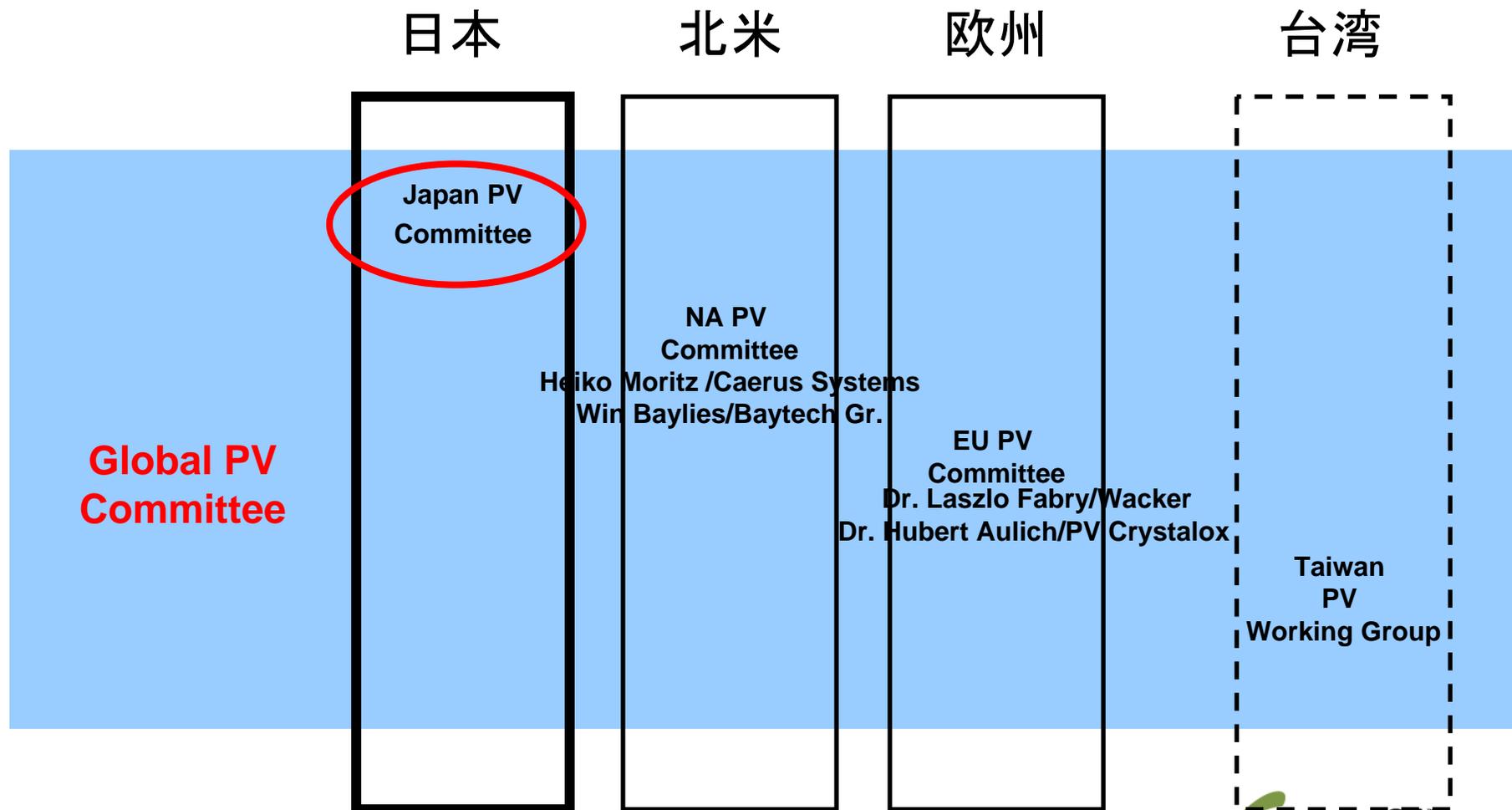
グローバル技術委員会 構成・階層



技術委員会
(19 Global
Technical
Committees)



Global PV STD Committee マトリクス



SEMI日本地区スタンダード委員会

日本地区スタンダード委員会

Chair: 小林 秀 (ルネサステクノジ)

Chair: 山本 眞 (村田機械)

Vice Chair: 真白 すぴか

Standardization Process

Integration (SPI) TF

真白すぴか (キヤノンアネルバ)

I&C委員会
坂本 見恒
(東京エレクトロ)
西村 剛幸
(大日本スクリーン製造)

PI&C委員会
小松 省二(アクティオン)
名和 健二郎
(東京エレクトロ)
櫻本 明(信越ポリマー)

外リクス委員
黒田久雄
(エム・イー・エス・アプティ)
古川 幹雄(信越ポリマー)

トレサビリティ委員会
本間 三智夫
(NECエレクトロニクス)
中村 靖司(安川電機)
西部 隆文(コバレントマテリアル)

シリコンウェハ委員会
河合 直行
(ルネサステクノジ)
成富 俊雄(SUMCO)

化合物半導体材料委員会
小原 正義
(信越半導体)
TBD

パッケージング委員会
加藤 凡典(エアイティ)
田畑 晴夫(アドバイザ)
狛 豊(アドバイザ)

テスト委員会
加賀 博史
(NECエレクトロニクス)
相原 秀俊(横河電機)

EHS委員会
佐倉 英俊(インテル)
真白 すぴか
(キヤノンアネルバ)
Moray Crawford
(初田製作所)

ガス及び設備委員会
榎並 弘充
(日立ハイテクノロジーズ)
鈴木 勲(日本エム・ケー・エス)

リキッドケミカル委員会
村岡 祐介
(大日本スクリーン製造)
富田 寛(東芝)

FPD基板・搬送・装置委員会
音川 泰伸(ダイヘン)
廣瀬 治道(芝浦メトロニクス)

FPDカラーフィルタ・光学委員会
有賀 久(セイコーエプソン)
古川 忠宏(共同印刷)
伊藤 浩光(凸版印刷)

FPDマスク委員会
岡崎 厚士
(エスケーエレクトロニクス)

FPD外ロジック委員会
渡辺良一
(東芝モバイルディスプレイ)
加藤 慎祐(シャープ)
依田優治(大塚電子)

マイクロパターニング委員会
東川 巖(東芝)

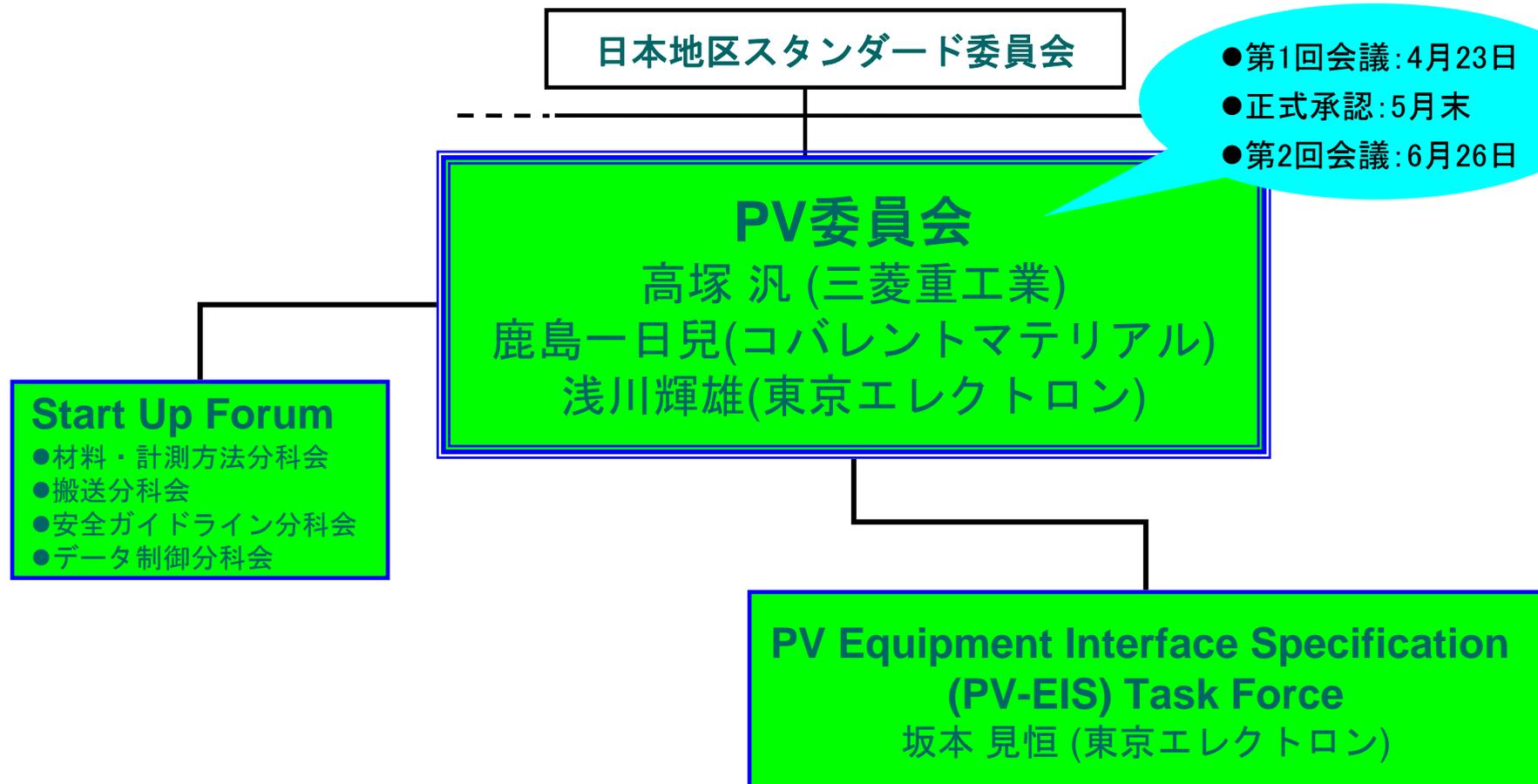
FPD Coordination Group
野上 良忠
(エスケーエレクトロニクス)
山本 眞(村田機械)

Coordination Group

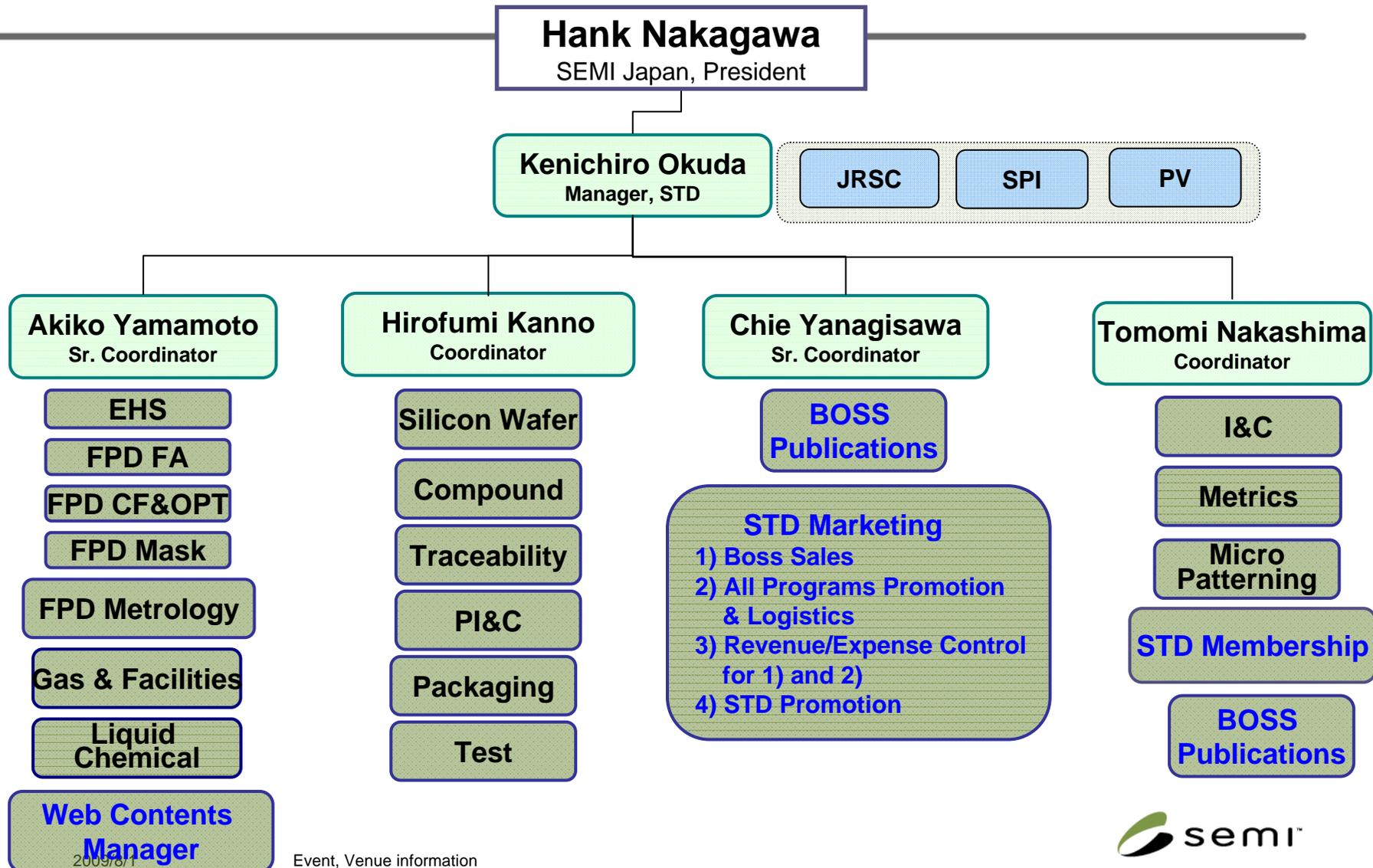
PV委員会
高塚 汎(三菱重工)
鹿島一日兒
(コバレントマテリアル)
浅川 輝雄
(東京エレクトロ)

5月末ISC承認済

日本地区PV技術委員会 組織図



Standards Dept. (as of May. 1, 2009)



International SEMI Standards Staff

Standards Headquarters Staff

*Director,
International Standards*
James Amano
408.943.7977
jamano@semi.org

Standards Publications & Administration
Tonya Maudlin
408.943.6964
tmaudlin@semi.org

Standards North America Staff

*Sr. Manager, NA Standards Operations,
Information & Control,
Physical Interfaces & Carriers*

Paul Trio
408.943.7041
ptrio@semi.org

*Facilities, Gases, Photovoltaics,
Silicon Wafer*
Kevin Nguyen
408.943.7997
knguyen@semi.org

*MEMS, Metrics, Microlithography,
Traceability*
Susan Turner
408.943.7019
sturner@semi.org

*Compound Semiconductor Materials
EHS, FPD, Liquid Chemicals*
Ian McLeod
408.943.6996
imcleod@semi.org

Standards Europe Staff

All Committees
Saviour Alfino
32.2.289.6612
salfino@semi.org

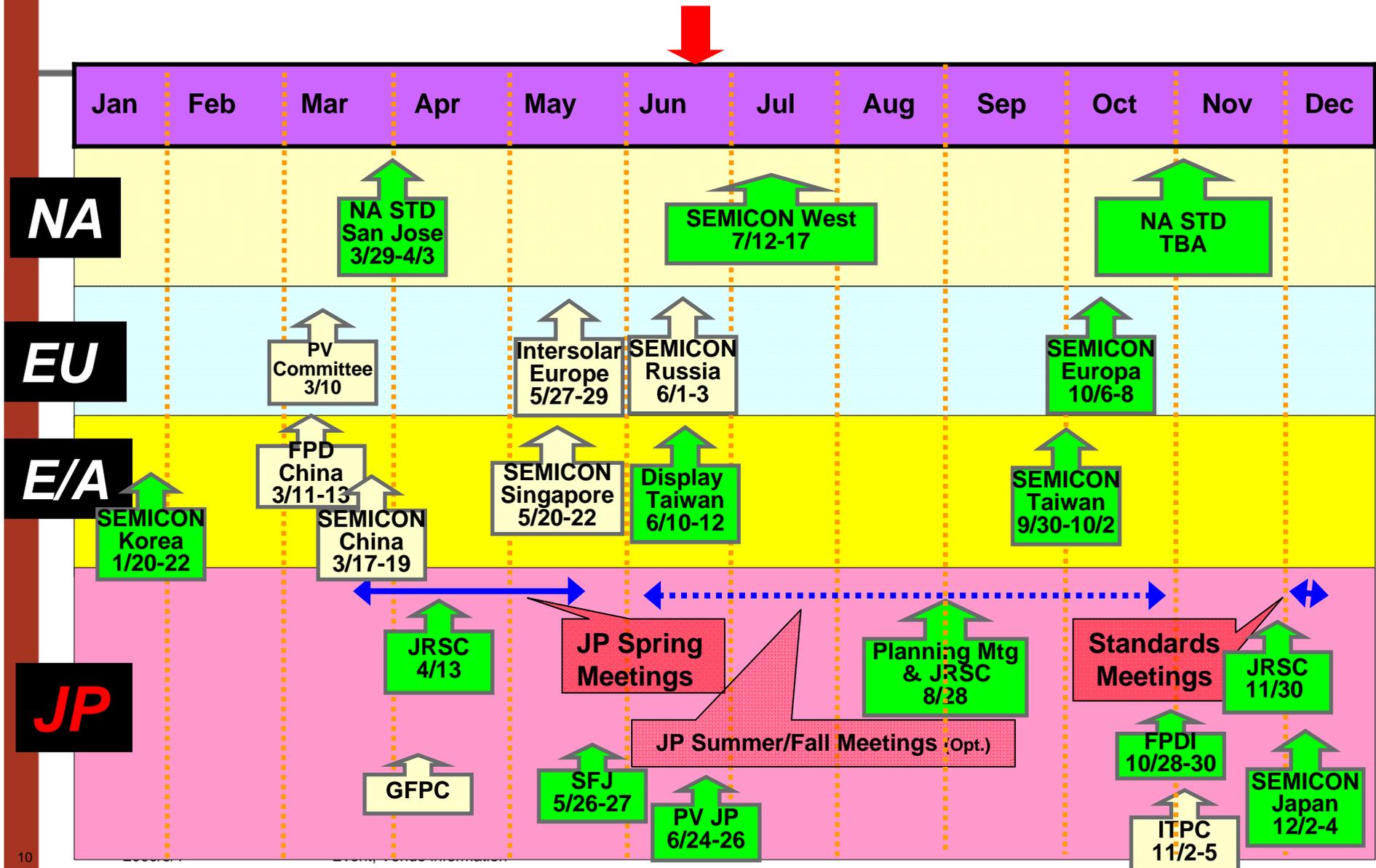
Standards Taiwan Staff

All Committees
Leon Huang
886.3.573.3399
lhuang@semi.org

Standards Korea Staff

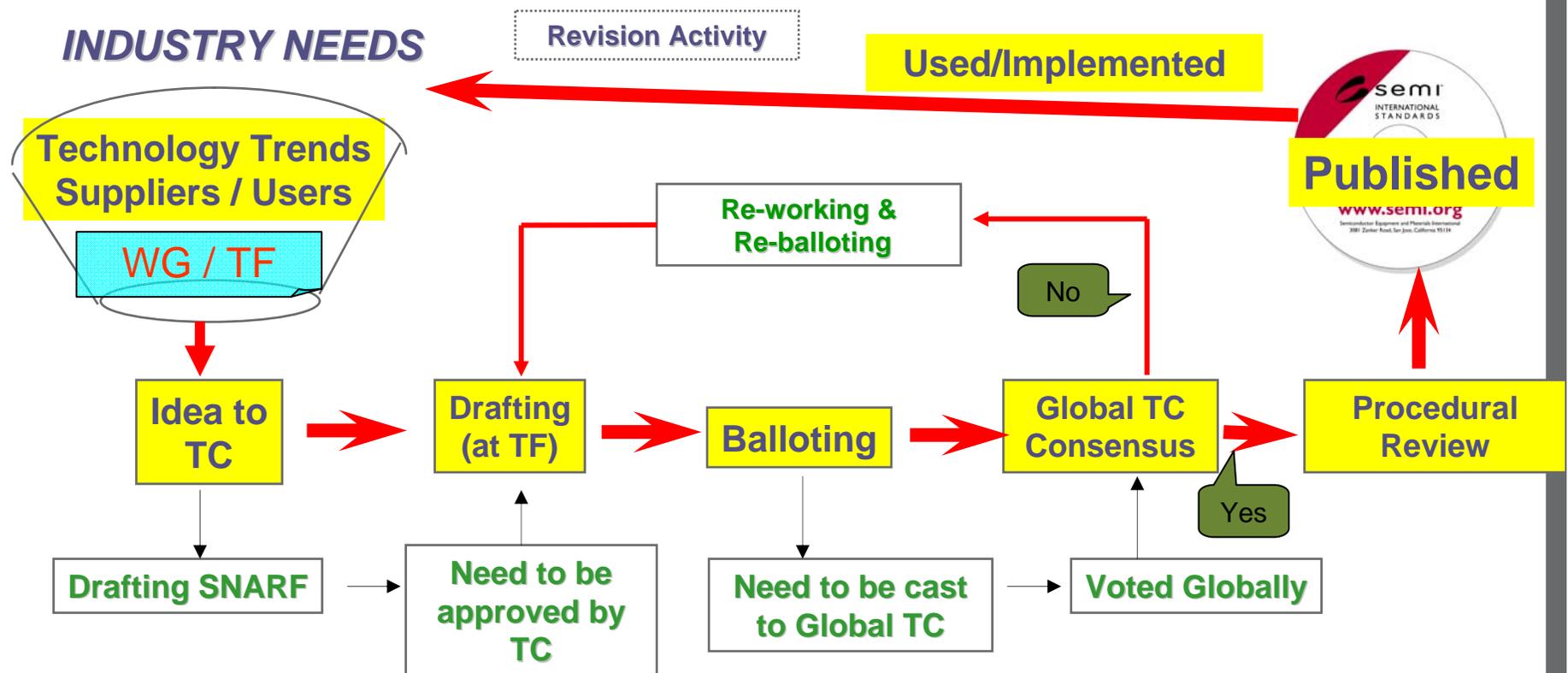
All Committees
Eun-Jung Shim
82.2.551.3401
eshim@semi.org

SEMI Standards Event Calendar 2009



Procedures <General>

SEMI Standards Development Cycle



2009年5月実施 手続審査結果 A&R Ballot Review Report Result of Cycle 7, 2008 and Cycle 1-2, 2009

		Committee Reviewed		Committee Passed		A&R SC Approved		Notes
		Full Doc.	Line item	Full Doc.	Line item	Full Doc.	Line item	
World -Wide (JP)	TB	51 (10)	41 (0)	19 (8)	30 (0)	19 (8)	30 (0)	新規: 4557 (PV2-0709): Guide For PV Equipment Communication Interfaces (PVECI) 4403 (D53-0709): Specification for Substrate Management of FPD Production (SMS-FPD) 4690 (D51-0709): New Related Information to SEMI D51-0308: Specification for Handshake Method of Single Substrate for Handling Off/On Tool in FPD Production 4466B (E152-0709): Mechanical Specification of EUV Pod for 150 mm EUVL Reticles 撤回: 4643 (T1-95): Specification for Back Surface Bar Code Marking of Silicon Wafers
	Preliminary	0 (0)		0 (0)		0 (0)		
	AUX	0 (0)		0 (0)		0 (0)		



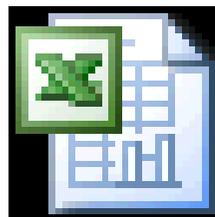
英語版/日本語版スタンダード集 アップデート付CD新規オーダーは6月末迄！

新旧	言語	商品	アップデート有無	受注窓口	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
従来商品	英語版	全規格CD-ROM	アップデート付きのみ販売	SEMI Japan 受付	2009年3月(0309)版 6月末で新規注文受付終了			アップデート分2009年7月(0709)版を 購入者へ送付			アップデート分2009年11月(1109)版を 購入者へ送付				
		個別規格PDFダウンロード	--	SEMI Japan 受付	従来どおりのお取扱い										
	日本語版	全規格CD-ROM	アップデート付き	オンデマンドライブラリ受付	2008年11月(1108)版 6月末で新規注文受付終了			アップデート分2009年3月(0309)版を 購入者へ送付			アップデート分2009年7月(0709)版を 購入者へ送付				
		全規格CD-ROM	アップデートなし	オンデマンドライブラリ受付	2008年11月(1108)版 販売			2009年3月(0309)版 販売			2009年7月(0709)版 販売				
		分野別PDFダウンロード	--	オンデマンドライブラリ受付	従来どおりのお取扱い										
		分野別オンデマンド印刷	--	オンデマンドライブラリ受付	年内販売終了(時期未定)										
		個別規格PDFダウンロード	--	オンデマンドライブラリ受付	従来どおりのお取扱い										
		個別規格オンデマンド印刷	--	オンデマンドライブラリ受付	年内販売終了(時期未定)										
	新商品	マルチ言語	「SEMIViews」全規格利用	--	SEMI Japan 受付									1年契約 出版サイクルという概念が ありません。	
			「SEMIViews」個別規格利用	--	SEMI Japan 受付									1年契約 出版サイクルという概念が ありません。	

* グレーは、2009年末にて販売終了の商品。



Global PV Committeeメンバー(登録者)の業界セクター別データ報告



Microsoft Office
Excel ワークシート

規約改訂に伴う、
STDメンバーシップ
登録のお願い

Thank you!

Any Question?

Backup

标准
Normen
規格
Standards
標準
표준
Стандарты

SEMIVIEWS

- SEMIVIEWSの概要
 - インターネット上で規格(単独/複数)をカスタマイズ利用
 - ユーザー名とパスワードを用いて随時アクセス
 - 閲覧・PDFダウンロード・検索・クロスレファレンス・リンケージ・脚注付記などが可能
 - 年間ライセンス方式
 - ユーザー数毎の価格設定
 - マルチ言語対応可能
 - 従来は言語別(英語版/日本語版)の出版
 - SEMIVIEWSでは言語を問わず規格毎の利用
 - 英語(オリジナル規格)+日本語訳+中国語(繁体字)訳(但し安全分野のみ)



SEMIVIEWS Features

- Phase 1:
 - Quickly access the Standards to use most often
 - Powerful Search within a single Standard, groups of Standards, or all Standards
 - Create, review, and edit notes and attach them to specific Standards content
 - Create cross-reference links between Standards
 - Assemble your own “collections” of Standards to work with
 - Multilingual capability, where available
 - English/Japanese/Traditional Chinese (Safety Vol.)
 - Automatic updates when revised



SV Price

SEMIVIEWS Future Features

- Potentials:
 - Collaboration on Standards documents
 - Version comparisons
 - Online courses and videos
 - “Side by Side” English and Translated ver.
 - Multilingual Screens

My Documents/Table of Contents:

Fast access to needed Standards; Attach and edit notes



Release: 1.0b3 Beta

Welcome Keith Peden! | [help](#) | [search](#) | [contact us](#) | [logout](#)

Module Navigator

My Documents

[SEMI-C003-00](#)
[SEMI-C003-02](#)
[SEMI-C003-06](#)
[SEMI-C003-12](#)
[SEMI-C003-15](#)
[SEMI-D003-00](#)
[SEMI-E001-09](#)
[SEMI-E005-00](#)
[SEMI-E040-00](#)
[SEMI-E040-01](#)
[SEMI-E087-00](#)
[SEMI-E087-01](#)
[SEMI-M006-00](#)
[SEMI-MF1727-00](#)
[SEMI-MF1810-00](#)
[SEMI-P014-00](#)
[SEMI-S005-00](#)

My Notes

My Collections

Administration

Settings

Help

[Welcome](#) | [SEMI-E040-00](#) | [SEMI-C003-02](#) | [my new collect](#) | [my note group](#) | [Global Search](#)

[Close](#)

[MyView](#) • [PDFView](#)

SEMI-E040-00-0705 STANDARD FOR PROCESSING MANAGEMENT

Table of Contents

1 Purpose

- 1.1 Automated management This standard addresses the communications needs within the semiconductor manufacturing environment with respect to the processing of material in equipment.
- 1.2 This standard specifies the application of the appropriate processing to specified material received at the processing agent. It describes the concepts of material processing, the behavior of the equipment in relation to processing, and the messaging services which are needed to accomplish the task.
- 1.3 The communications services defined here enable standards-based interoperability of independent systems. They allow application software to be developed that can assume the existence of these services and allow software products to be developed which offer them.
- 1.4 Implementation of automated processing management will help eliminate misprocessing of material. The adoption of the standards described will greatly reduce the effort required to integrate compliant equipment components and reduce time to set up for processing. Compliance requires a minimal but significant amount of standard compliance.

Easy Access to PDFs:

View/print Standards in original format (PDF); Multiple local languages

SEMIViews画面例



Release: 1.0b3 Beta

Welcome Keith Peden! | [help](#) | [search](#) | [contact us](#) | [logout](#)

Module Navigator

- My Documents
- My Notes
- My Collections
- Administration
- Settings
- Help

Welcome SEMI-E040-00 SEMI-C003-02 my new collect my note group Global Search SEMI-E001-09 [Close](#)

[MyView](#) • [PDFView](#)

Licensed by SEMI to Keith Peden
Downloaded: 2008-11-24
Single-user license only, copying and networking prohibited.

SEMI E1.9-1106
300 mm ウェーハ搬送および保管用ウェーハカセットの機械仕様

本仕様は、global Physical Interfaces & Carriers Committee で技術的に承認されている。現版は 2006 年 8 月 24 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2006 年 10 月に www.semi.org で、そして 2006 年 11 月に CD-ROM で入手可能となる。初版は 1994 年発行、前版は 2006 年 7 月発行。

1 目的

1.1 本スタンダードは、IC 製造工場において 300 mm 径ウェーハの搬送および保管に使用されるカセットを規定する。これには、手動・自動両方の搬送用途と同様にプロセス装置におけるウェーハの高速取り出しも含まれる。



Side-by-Side Documents:

View documents side-by-side; Link documents to each other



Release: 1.0b3 Beta

Welcome Keith Peden! | [help](#) | [search](#) | [contact us](#) | [logout](#)

Module Navigator

- My Documents
- My Notes
- My Collections
- Administration
- Settings
- Help

Welcome
SEMI-E040-00
SEMI-C003-02
my new collect
my note group
Global Search

[Close](#)

MyView • PDFView

SEMI-E040-00-0705 STANDARD FOR PROCESSING MANAGEMENT

Table of Contents

10.2 Service List — The following messages are exchanged between host and equipment for the purpose of accomplishing processing management tasks.

Table 4 Service List

<input type="checkbox"/> Message Name	<input type="checkbox"/> Type	<input type="checkbox"/> Description
<input type="checkbox"/> PRGetAllJobs	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> Get a list of the jobs and their states for all jobs which have not completed.
<input type="checkbox"/> PRGetSpace	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> Get the number of jobs which can currently be created on the resource.
<input type="checkbox"/> PRJobAlert	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Notification by the processing resource that the process job is setting up, processing, completed process, or that the job is completed.
<input type="checkbox"/> PRJobCommand	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> Command which affects the process job.

SEMI-E040-01-0705 SECS-II SUPPORT FOR PROCESSING MANAGEMENT STANDARD

Table of Contents

5 **Mapping of Processing Services**

Table 1 Processing Management Messages Mapping

<input type="checkbox"/> Service Message Name	<input type="checkbox"/> Stream, Function	<input type="checkbox"/> SECS-II Name
<input type="checkbox"/> PRJobCreate request	<input type="checkbox"/> S16F3,F4	<input type="checkbox"/> Process Job Create Request/Acknowledge
<input type="checkbox"/> PrJobCommand request	<input type="checkbox"/> S16F5,F6	<input type="checkbox"/> Process Job Command Request/Acknowledge
<input type="checkbox"/> PRJobAlert notify	<input type="checkbox"/> If E30 style events: <input type="checkbox"/> S6F11,F12 <input type="checkbox"/> If E40	<input type="checkbox"/> If E30 style events: <input type="checkbox"/> Event Report Send/Acknowledge <input type="checkbox"/> If E40 style alerts:

Search Capabilities:

Search within a single Standard, groups of Standards, or all Standards



Release: 1.0b3 Beta

Welcome Keith Peden! | [help](#) | [search](#) | [contact us](#) | [logout](#)

Module Navigator

- [My Documents](#)
- [My Notes](#)
- [My Collections](#)
- [Administration](#)
- [Settings](#)
- [Help](#)

Welcome
SEMI-E040-00
SEMI-C003-02
my new collect
my note group
Global Search
SEMI-E001-09

[Close](#)

[MyView](#) • [PDFView](#)

SEMI-E040-00-0705 STANDARD FOR PROCESSING MANAGEMENT

[Table of Contents](#)

10.2 Service List — The following messages are exchanged between host and equipment for the purpose of accomplishing processing management tasks.

Table 4 Service List

<input type="checkbox"/> Message Name	<input type="checkbox"/> Type	<input type="checkbox"/> Description
<input type="checkbox"/> PRGetAllJobs	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> Get a list of the jobs and their states for all jobs which have not completed.
<input type="checkbox"/> PRGetSpace	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> Get the number of jobs which can currently be created on the resource.
<input type="checkbox"/> PRJobAlert	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Notification by the processing resource that the process job is setting up, processing, completed process, or that the job is completed.
<input type="checkbox"/> PRJobCommand	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> Command which affects the process job.

Search Results

Search phrase: process

Para	Text
8.2	Process Job Communications
8.2.1.4	Figure 2 Process Job Message Flow
8.3	Process Job State Model — The process job is a transient entity.
8.3.2.5	Figure 4 Process Job State Model
8.3.3	Table 1 Process Job State Transition Table
8.3.3	Acknowledge the Process Job creation.
8.3.3	PROCESS COMPLETE
8.3.3	Delete the process job.
9.2.1	Table 2 Process Job Attributes
9.2.1	PROCESS COMPLETE
10.2	Command which affects the process job.
10.3	Process job milestone

SEMIスタンダードの例

「日本地区満足度調査(08年3月実施)」結果より

- よく使われている規格のトップ10

Rank.	Qty	Std. #	Category	Standard Name
1	45	S2	安全ガイドライン	半導体製造装置の環境, 健康, 安全に関するガイドライン
2	27	S8	安全ガイドライン	半導体製造装置の人間工学エンジニアリングに対する安全ガイドライン
3	18	E30	製造装置ソフトウェア	製造装置の通信およびコントロールのための包括的モデル(GEM)
4	16	E5	製造装置ソフトウェア	半導体製造装置通信スタンダード2 メッセージ内容(SECS-II)
5	15	E84	製造装置ソフトウェア 製造装置ハードウェア	エンハンスドキャリア移載パラレルI/O インタフェースの仕様
6	14	S10	安全ガイドライン	リスクアセスメントおよびリスク評価のための安全ガイドライン
7	13	E37	製造装置ソフトウェア	高速SECS メッセージサービス(HSMS) 汎用サービス
7	13	E87	製造装置ソフトウェア	キャリア管理(CMS)のための仕様
8	9	E132	製造装置ソフトウェア	装置クライアントの認証(Authentication)および権限付与(Authorization)のための仕様
8	9	E40	製造装置ソフトウェア	プロセス管理スタンダード
9	8	E10	製造装置ハードウェア	半導体製造装置の信頼性, 有用性, 整備性の定義と測定のための仕様
9	8	E120	製造装置ソフトウェア	共通装置モデル(CEM)の仕様
9	8	E125	製造装置ソフトウェア	装置自己記述(EqSD)の仕様
9	8	E4	製造装置ソフトウェア	半導体製造装置通信スタンダード1 メッセージトランスファ(SECS-I)
9	8	E94	製造装置ソフトウェア	コントロールジョブ管理(CJM)の仕様
10	7	E116	製造装置ソフトウェア	装置性能トラッキング(EPT)のための仕様
10	7	E134	製造装置ソフトウェア	データ収集管理の仕様

